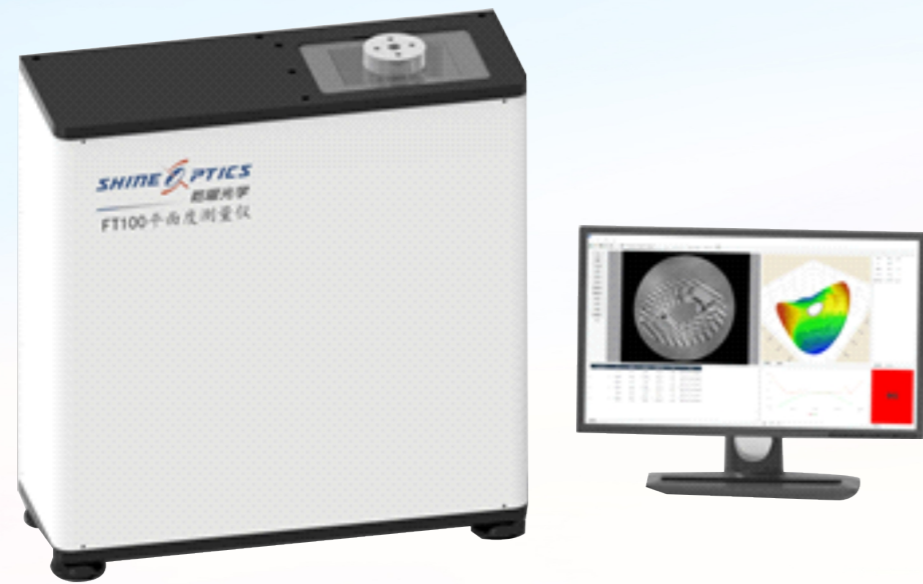


FlaTester平面度测量仪家族 新

快速准确地测量机加工、研磨、抛光和超精密加工的样品表面形状

现代精密制造中，当需要确定整个表面的平整度，单线扫描仪和三坐标测量仪都因为测量的数据量太少而无法达到要求，我们的FlaTester平面度测量仪可以在几秒钟内非接触地测量零件的整个表面，不同尺寸和复杂形状均可测量。

FlaTester的分辨率达到5nm，准确度为50nm。保证可以快速、精确测量平面度、线形、半径等各种表面参数，并且适用于多种材料和表面处理方式。

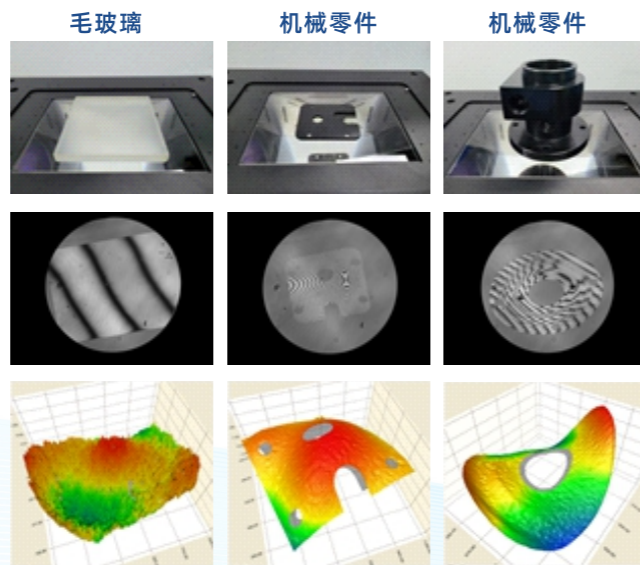


关键性能

- ▶ 非接触、无损伤测量
- ▶ 最大达到100μm的动态测量范围
- ▶ 光学量级的分辨率和精度
- ▶ 秒级实现整个表面特征的测量
- ▶ 可以测量多种材料：半导体晶圆、LCD掩膜、玻璃、金属、复合材料、陶瓷等
- ▶ 适用多种类型表面：机加工表面、研磨表面、抛光面，超光滑面等

好学易用

- ▶ 无需工装夹具，放置好样品即可测量
- ▶ 软件操作方便，界面友好，直观展现样品的二维和三维轮廓
- ▶ 测量结果客观，不易受作业员操作影响
- ▶ 适用于生产现场、质量控制和开发验证等多种场合，提高产品质量和产品，提升品质直通率



仪器规格参数表

产品型号	FT100	FT200
结构形式	倒立式	
测量方式	掠入射	
光源	氦氖激光 (632.8nm)	
相机	靶面1/1.2"，有效分辨率1.2KX1.2K	
有效通光口径	100mm	200mm
样品尺寸	25-100mm	25-200mm
量程	>100μm	>100μm
精度	50nm	50nm
重复性	15nm (标准偏差)	
测量时间	5秒	
测量数据点	最高达23万个点	
测量基准	小二乘法	
可测量材料	半导体晶圆、LCD掩膜、玻璃、金属、复合材料、陶瓷等	
可测量表面	机加工表面、研磨表面、抛光面，超光滑面等	
样品反射率	85°入射角R>10%	
样品粗糙度	Ra<1.0μm	
仪器尺寸(长宽高)	700x260x720mm	700x340x720mm
仪器重量	96KG	110KG
电源	100-240VAC, 50/60Hz	
工作环境温度	15°C - 30°C	
温度变化率	<1.0°C/30min	
湿度	不大于70%	